

EV Group announces multi-functional micro- and nanoimprint solution 'EVG7300' - January 19, 2022

EVG introduced the EVG®7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company's most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. The EVG7300 system is offered as both a stand-alone tool as well as an integrated module in EVG's HERCULES® NIL fully integrated UV-NIL track solution where additional pre-processing steps, such as cleaning, resist coating and baking or post-processing, can be added to optimize for particular process needs.

EV그룹, 다기능 마이크로나노임프린트 솔루션 EVG7300 출시

최복재 기자 | 승인 2022.01.19 10:31 | 댓글 0

| **대량생산 공학 기기 제조용으로 유연성 제공**



EV그룹 EVG7300

[아이티비즈 박재은 기자] EV그룹(EVG)은 자동화된 스마트NIL(SmartNIL) 나노임프린트 및 웨이퍼 레벨 광학 시스템인 EVG7300을 출시한다고 19일 밝혔다.

EVG의 최신 솔루션인 EVG7300은 나노임프린트 리소그래피(NIL), 렌즈 몰딩 및 렌즈 스택킹(UV 본딩) 같은 UV 기반의 여러 프로세스를 단일 플랫폼에 결합한 것이 특징이다. 이 산업용 다기능 시스템은 마이크로 및 나노 패터닝은 물론 레이어 적층 등을 포함하는 광범위한 신규 애플리케이션의 첨단 R&D와 생산 공정 모두에 사용될 수 있다.

이러한 애플리케이션의 사례에는 웨이퍼 레벨 광학(WLO), 광학 센서와 프로세서, 차량용 조명, 증강현실(AR) 헤드셋용 웨이브가이드, 바이오 의료 장비, 메타 렌즈와 메타 표면 광전자 기기 등이 포함된다. 최대 300mm 웨이퍼까지 지원하고 고정밀 임라인먼트 향상된 프로세스 제어, 우수한 스루풋 성능을 제공하는 EVG7300은 다양한 자유도와 높은 정밀도로 나노 및 마이크로 광학 부품과 기기를 대량 생산하고자 하는 사용자의 요구를 충족한다.

EVG7300은 독립된 플랫폼에서 사용하거나, 또는 EVG의 HERCULES UV-NIL 트랙 솔루션에 하나의 모듈로 통합해 사용할 수 있다. EVG의 HERCULES UV-NIL 트랙 솔루션은 사용자의 특정 프로세스 요건에 따라서 세정과 레지스트 코팅 및 베이킹 같은 전처리 공정이나 후처리 공정을 추가할 수 있다.

EV그룹의 트마스 클린스어 기술개발 디렉터는 "나노임프린트 기술에 있어서 20년 이상의 경험을 보유한 EV그룹은 고객의 변화하는 요구를 충족하기 위해 지속적인 기술 혁신을 통해 더 나은 솔루션을 제공하고 있다. 최신 나노임프린트 솔루션인 EVG7300은 EVG 고유의 스마트NIL 플랫폼도 임프린트 기술에 렌즈 몰딩과 렌즈 스택킹을 단일 플랫폼에 결합하고 있으며 시장에서 가장 정밀한 임라인먼트와 고정 파라미터 제어가 특징인 시스템으로서, 고객이 연구개발과 양산 공정 모두에 사용할 수 있게 해주는 유연성을 제공한다"고 말했다.